

## プラズマエッチング装置



プラズマエッチング装置

(株) ユーテック

YR-4011 1H-DX II

平成4年度導入

### 【主な用途・仕様】

シリコンの等方性ドライエッチングおよびレジストのアッシング

- ・ サンプルサイズ：φ 2 インチ
- ・ プラズマ発生：誘導結合型
- ・ RF 電源：max 200W (13.56MHz)
- ・ ガス：SF<sub>6</sub>、O<sub>2</sub>

### 【設備使用】

プラズマエッチング装置

### 【委託分析試験】

マイクロマシニング加工 (B)